## Об особенностях радиационного дефектообразования в p-Si $\langle$ B,Pt $\rangle$

© М.С. Юнусов, М. Каримов, М. Аликулов, А. Ахмадалиев, Б.Л. Оксенгендлер, С.С. Сабиров Институт ядерной физики академии наук Узбекистана 702132 Улугбек, Узбекистан

(Получена 31 января 1996 г. Принята к печати 25 октября 1996 г.)

Обсуждаются результаты исследования радиационного дефектообразования в p-Si $\langle$ B,Pt $\rangle$  методом релаксационной спектроскопии глубоких уровней. Показано существенное влияние наличия исходной примеси В и Pt на эффективность образования радиационных центров (особенно с энергией  $E_v + 0.36$  эВ). Это явление объясняется наличием в p-Si $\langle$ B,Pt $\rangle$  электрически нейтральных комплексов  $\langle$ cобственный межузельный атом $\rangle$ -примесь, которые в процессе  $\gamma$ -облучения, эффективно распадаясь, влияют на характер квазихимиеских реакций радиационного дефектообразования.

Исследованию электрических и фотоэлектрических свойств  $\mathrm{Si}\langle\mathrm{Pt}\rangle$  посвящен ряд работ [1–3]. В этих работах показано, что платина создает в запрещенной зоне уровни энергии  $E_c-0.26$  эВ,  $E_c-0.53$  эВ,  $E_v+0.34$  эВ. Обнаружено существенное влияние Pt на процессы радиационного дефектообразования [1,3]. Однако механизм радиационных процессов в  $\mathrm{Si}\langle\mathrm{Pt}\rangle$  остается еще не до конца выясненным.

Для исследований был использован кремний p-типа, выращенный методом Чохральского, с различной концентрацией примесей В ( $N_{\rm B}=10^{15}\div10^{16}\,{\rm cm^{-3}}$ ) и Рt ( $N_{\rm Pt}=6\cdot10^{13}\div6\cdot10^{14}\,{\rm cm^{-3}}$ ). Платина в p-Si $\langle$ B $\rangle$  вводилась методом термодиффузии в течение примерно 10 ч. Для учета влияния термообработки на материал при температуре диффузии параллельно отжигались и контрольные образцы p-Si $\langle$ B $\rangle$ . Для проведения DLTS-измерений из образцов созадавлись диоды Шоттки напылением Au и Sb.

Легированные  $(p\text{-Si}\langle B, \text{Pt}\rangle)$  и контрольные  $(p\text{-Si}\langle B\rangle)$  образцы подвергались облучению  $\gamma$ -квантами  $^{60}\mathrm{Co}$  с интенсивностью 2500 P/c до интегральных доз порядка  $10^9$  рад. Сопоставляя спектры DLTS облученных образцов с литературными [4,5], мы пришли к выводу, что наблюдаемый локальный уровень энергии  $E_v+0.25$  эВ относится к дивакансии  $[V_2]$ , уровень  $E_v+0.36$  эВ — к комплексу  $V_2-\mathrm{O}_i-\mathrm{C}_i$ , где  $\mathrm{O}_i$  и  $\mathrm{C}_i$  — межузельные кислород и углерод, а уровень  $E_v+0.44$  эВ — к хорошо известному комплексу "вакансия- $\langle$ атом бора $\rangle$ "  $V+\mathrm{B}$ . Причем эффективность введения этих радиационных центров намного выше в образцах, легированных Pt, чем в контрольных.

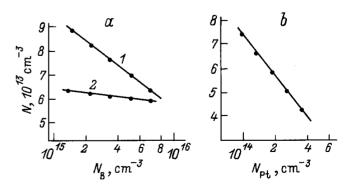
На рисунке приведены зависимости концентрации радиационных центров с энергией  $E_v + 0.36$  эВ от концентрации В (a) и от концентрации Pt (b). Анализ результатов, приведенных на рисунке показывает, что при постоянной концентрации атомов В  $(N_{\rm B}={\rm const})$  с ростом концентрации атомов платины  $N_{\rm Pt}$  концентрация радиационных центров с энергией  $E_v + 0.36$  эВ уменьшается (рисунок, b). Почти такая же зависимость концентрации этих центров от концентрации бора  $N_{\rm B}$  наблюдается и в случае, когда концентрации легирующей Pt в образце постоянна  $(N_{\rm Pt}={\rm const})$  (рисунок, a, прямая I). Однако концентрация этих центров в образцах p-Si $\langle B, Pt \rangle$  больше,

чем в контрольном образце p-Si $\langle B \rangle$ , содержащем близкую концентрацию В (рисунок, a, прямая 2). В последнем случае зависимость  $N(N_{\rm B})$  значительно слабее. Из анализа этих результатов следует, что на эффективность введения радиационных дефетов с энергией  $E_{\nu}+0.36$  эВ в основном влияет наличие легирующей примеси Pt.

Таким образом, при исследовании воздействия  $\gamma$ -излучения на p-Si $\langle B \rangle$  и p-Si $\langle B, Pt \rangle$  получены следующие экспериментальные результаты:

- эффективность введения наблюдаемых радиационных центров (особенно с энергией  $E_{\nu}+0.36$  эВ) в  $p\text{-Si}\langle \text{B,Pt}\rangle$  выше, чем в образце  $p\text{-Si}\langle \text{B}\rangle$ , не содержащем Pt;
- зависимости эффективности дефектообразования (особенно дефектов с энергией  $E_{\nu}+0.36$  эВ) от концентраций В и Рt подобны, т. е. с ростом концентрации В и Рt эффективность падает, но в Si, содержащем Pt, она всегда выше.

Эти нетривиальные результаты удалось объяснить на основе учета амфотерности примеси Pt в кремнии и представлении об участии в квазихимических реакциях наряду с первично рожденными вакансиями (V) как собственных межузельных атомов (I), так и продуктов распада комплексов Pt+I. Рассмотрим на основе таких представлений квазихимические реакции радиационного дефектообразования в Si.



Зависимости концентрации радиационных центров N с энергией  $E_v+0.36$  эВ: a — от концентрации бора  $N_{\rm B}$ , I — для p-Si $\langle$ B,Pt $\rangle$ , 2 — для p-Si $\langle$ B $\rangle$ , b — от концентрации платины  $N_{\rm Pt}$ .

Система кинетических уравнений для такого процесса будет иметь следующий вид:

$$\begin{split} d[V]/dt &= \lambda - k_1[I][V] - k_2[V][B_i] - k_3[V][Pt] - [V]/\tau_V, \\ d[I]/dt &= \lambda - k_1[I][V] - k_4[I][Pt] - [I]/\tau_I, \\ d[V_2 + C_i + O_i]/dt &= \lambda - k_2[V_2 + C_i + O_i] - [V_2 + C_i + O_i]/\tau_{VCO}, \end{split}$$

где  $k_j$  — константы соответствующих реакций, а последние члены уравнений типа  $[A]/\tau_A$  определяют вероятность ухода дефектов типа A на стоки. Здесь учтено взаимодействие вакансий с межузельным бором  $B_i$ . Для случая нелегированного платиной кремния ([Pt]=0), т.е. для p-Si $\langle B \rangle$  и квазистационарного условия по I(d[I]/dt=0), получим

$$[I] = \lambda \tau_I, \qquad [V](t) = \lambda T_V \Big( 1 - e^{-t/T_V} \Big),$$

где  $1/T_V=k_1\lambda\tau_I+k_2[\mathbf{B}_i]+1/\tau_V$ . Если считать, что образующиеся радиационные комплексы  $V_2+\mathbf{C}_i+\mathbf{O}_i$ , практически не распадаясь, накапливаются (т. е.  $\tau_{VCO}\to\infty$ ), то получим

$$[V_2 + C_i + O_i] = k_2[CO]\lambda T_V \{t + T_V (e^{-\tau/T_V} - 1)\}.$$

Отсюда видно, что с ростом концентрации В<sub>і</sub> скорость накопления и стационарное значение (при  $t \to \infty$ ) концентрации комплекса  $V_2 + C_i + O_i$  падает. Этот результат соответствует эксперименту. Объяснение заключается в том, что узельный бор (В<sub>s</sub>) служит стоком для собственных межузельных атомов I, вытесняющих  $B_s$  из узла кристаллической решетки [6], которые участвуют в образовании радиационного центра  $V + B_i$ . Оставшаяся часть I уходит на вытеснение узельного кислорода  $(O_s)$  и углерода  $(C_s)$ , которые участвуют в образовании комплесов  $V_2 + C_i + O_i$ . А другая компонента пар Френкеля — вакансии — в основном принимает участие в захвате межузельного бора  $V+\mathrm{B}_i$  и в образовании комплексов  $V_2 + C_i + O_i$ . При этом эти процессы являются взаимно конкурирующими, т. е. с уменьшением концентрации исходного В эффективность захвата Ві вакансией уменьшается, а эффективность образования комплексов  $V_2 + C_i + O_i$ , наоборот, увеличивается.

Теперь рассмотрим случаи  $[Pt] \neq 0$ , т.е. образцы легированы примесью Pt.

a. Допустим, что в процессе легирования кремния примесью Pt ее атомы преимущественно взаимодействуют с вакансиями и образуют с ними комплексы, (т.е.  $k_3 \gg k_4$ ). При облучении такие комплексы, распадаясь, дополнительно выделяют вакансии, которые участвуют в квазихимических реакциях дефектообразования. Тогда можно показать, что

$$[V_2 + C_i + O_i] = k_2[CO]\lambda \tilde{T}_V \left\{ t + \tilde{T}_V \left( e^{-t/\tilde{T}_V} - 1 \right) \right\},\,$$

где  $1/\tilde{T}_V = 1/T_V + k_3[\text{Pt}]$ . Очевидно, что

$$\frac{[V_2 + C_i + O_i]_{[Pt] \neq 0}}{[V_2 + C_i + O_i]_{[Pt] = 0}} = \frac{k_1 \lambda \tau_I + k_2 [B_i] + 1/\tau_V}{k_1 \lambda \tau_I + k_2 [B_i] + 1/\tau_V + k_3 [Pt]} < 1.$$

т. е. вне зависимости от концентрации В процесс образования комплекса  $V_2 + \mathrm{C}_i + \mathrm{O}_i$  всегда подавлен.

 $\delta$ . Аналогичным образом можно предположить, что в процессе легирования p-Si примесью Pt ее атомы преимущественно образуют комплексы с межузельными атомами и эти комплексы, распадаясь при облучении, дополнительно поставляют межузельные состояния атомов. Последние участвуют в квазихимичеких реакциях радиационного дефектообразования и приводят к повышению эффективности образования комплексов  $V_2+C_i+O_i$  независимо от концентрации В. Для данного случая

$$\begin{split} &\frac{[V_2 + \mathbf{C}_i + \mathbf{O}_i]_{[\text{Pt}] \neq 0}}{[V_2 + \mathbf{C}_i + \mathbf{O}_i]_{[\text{Pt}] = 0}} \\ &= \frac{1 + \tau_V \left( k_2[\mathbf{B}_i] + k_1 \lambda \tau_I \right)}{1 + \tau_V \left\{ k_2[\mathbf{B}_i] + k_1 \lambda \tau_I / (1 + k_3[\text{Pt}]\tau_3) \right\}} > 1. \end{split}$$

Отметим, что только при учете этого факта удается естественно объяснить полученные результаты.

Таким образом, при анализе процессов радиационного дефектообразования в кремнии, содержащем переходные элементы, в частности Pt, следует учитывать такой важный фактор как преимущественное образование в процессе легирования комплексов Pt+I и активную роль продуктов распада этого комплекса (I) в квазихимических реакциях радиационного дефектообразования.

## Список литературы

- [1] А.А. Лебедев, Н.А. Султанов. ФТП, 22, 16 (1988).
- [2] Y.K. Kwon, T. Ishikawa, H. Kuwano. J. Appl. Phys., **61**, 1055 (1987).
- [3] М.Ю. Юнусов, А. Ахмадалиев, С.С. Сабиров. ФТП, **29**, 665 (1995).
- [4] В.В. Емцев, Т.В. Машовец. Примеси и точечные дефекты в полупроводниках (М., Радио и связь, 1987).
- [5] Сб.: Вопросы радиационной технологии полупровдников (Новосибирск, Наука, 1980).
- [6] G.D. Watkins. *The lattice vacancy in Silicon (Deep centers in Semiconductors)* (N.Y., Academy Press, 1986) Ch. III, p. 147.

Редактор Т.А. Полянская

## On radiation defect production in p-Si $\langle$ B,Pt $\rangle$

M.S. Yunusov, M. Karimov, M. Alikulov, A. Akhmadaliev, B.L. Oksengendler, S.S. Sabirov Institute of Nuclear Physics, Academy of Sciences of Uzbekistan, 702132 Ulugbek, Uzbekistan

**Abstract** The results of the defect production processes investigation in p-Si $\langle$ B,Pt $\rangle$ , studed by means of DLTS-method, are being discussed. It is shown that initial doping impurities B and Pt affect generation of radiation centers (particularly  $E_{\nu}+0.36$  eV). The phenomenon is explained in terms of decays of electrically inactive centers. The decay components affect quasichemical reactions, thus influencing the radiation defect production.